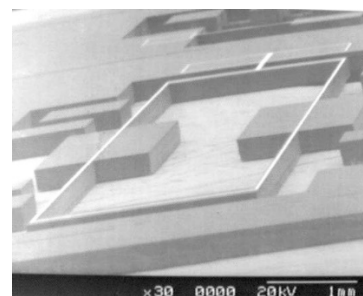
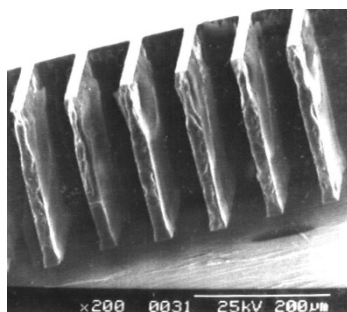
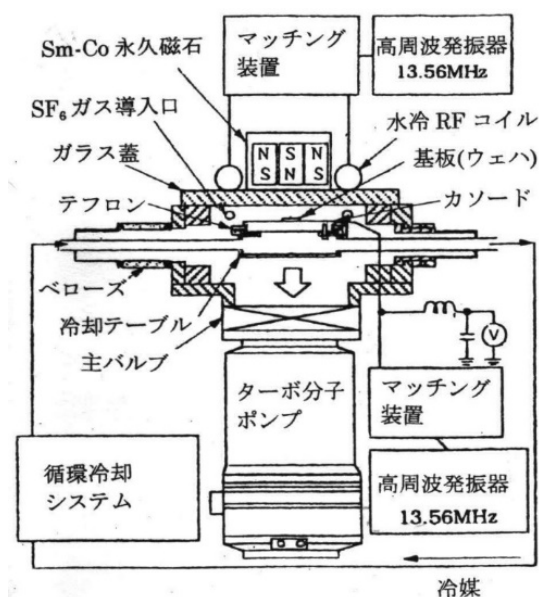
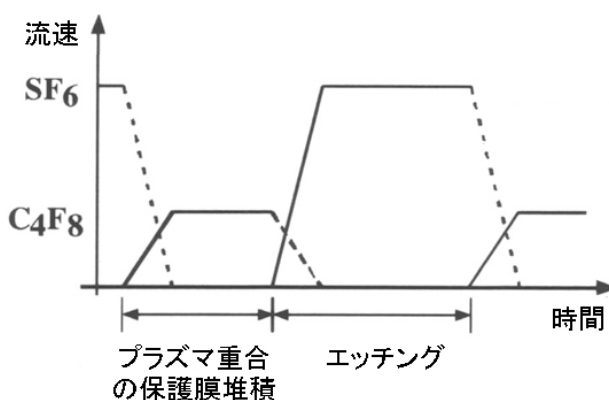
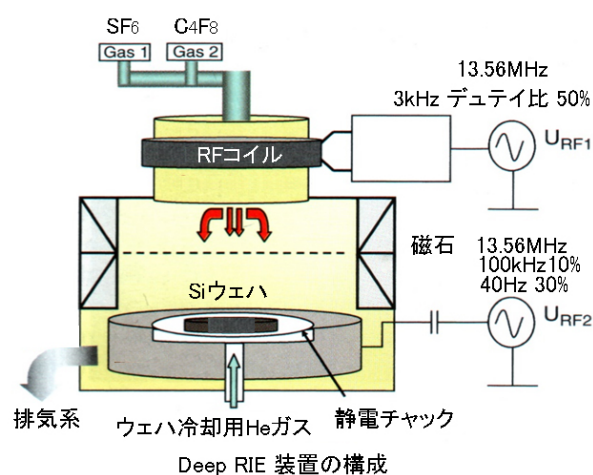


14 深い反応性イオンエッチング (Deep RIE (Reactive Ion Etching))

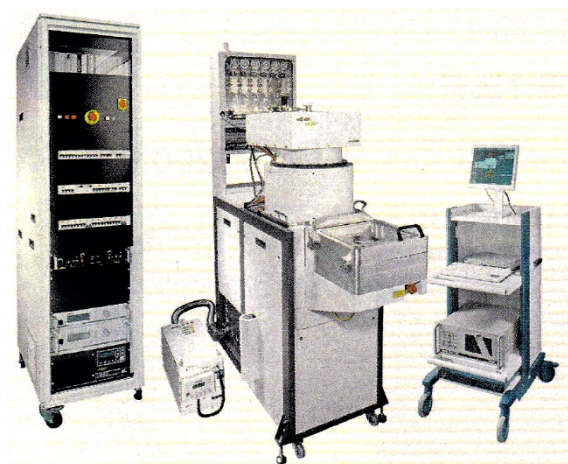


東北大学の低温 Deep RIE 装置と貫通エッチングによる振動ジャイロウェハ (右)
(M.Takinami, K.Minami and M.Esashi, 11th Sensor Symposium, (1992) 15)



保護膜堆積とエッチング

(F.Laermer (R.Bosch), Comprehensive Microsystems, Elsevier (2007) .217)



アルカテル社の Deep RIE 装置 (展示) SPP Technologies (住友精密工業)社の装置